

Amirkabir Journal of Mechanical Engineering

Amirkabir J. Mech. Eng., 56(10) (2025) 1429-1450 DOI: 10.22060/mej.2025.23611.7788

Comprehensive Dynamic Modeling and Characterization of a Piezoelectric Droplet Dispenser

Pouya Firuzy Rad, Hamed Ghafarirad * ⁽⁰⁾, Seyed Mehdi Rezaei

Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

ABSTRACT: Piezoelectric dispensers are widely applicable devices across many industries. However, their electromechanical structure often poses complexity in dynamic modeling. The interplay of many components especially compliant mechanisms and piezoelectric actuators makes modeling of the system challenging. In this study, the components of the system have been modeled individually and coupled together to predict the system behavior. For analyzing the bridge-type compliant mechanism, an appropriate method is proposed to model the structure with limited states. The mentioned method can predict the component behavior without sacrificing the precision which makes it ideal for coupling with other components dynamics. Additionally, a non-linear modeling approach is introduced to capture the piezoelectric non-linear hysteresis behavior. Finally, by coupling the whole system dynamic, a comprehensive model is reached. The model developed for the compliant mechanism is individually validated by FEM software and experiments to prove the accuracy. The hysteresis nonlinear model is also identified and validated with the experiments with R squared exceeding 0.98. The entire coupled dynamics of the electromechanical system are identified and tested across several input frequencies. R-squared values exceed 0.95 for all input frequencies, affirming the accuracy of the dynamic model.

Review History:

Received: Oct. 19, 2024 Revised: Jan. 29, 2025 Accepted: Feb. 21, 2025 Available Online: Mar. 03, 2025

Keywords:

Droplet Dispensing System Piezoelectric Dynamic Modeling Compliant Mechanism Hysteresis

1-Introduction

Piezoelectric dispensers are widely used in various industries due to their precision and agility, though their complex electromechanical design presents challenges. One major issue is that the piezoelectric actuator's displacement may not always suffice for effective dispensing. Traditional solutions include hinge-lever systems to amplify displacement, but these have limitations, such as needle misalignment, reduced actuator lifespan due to bending, and the need for dual actuators[1, 2]. Modeling these systems with commercial simulation software like ADAMS, SimulationX, and Ansys FEM offers accuracy but at high computational costs[1, 3]. Recent research has explored compliant mechanisms, which use structural flexibility for displacement amplification, offering potential advantages over hinge-lever systems[4]. However, compliant mechanisms are more complex to model. Analytical and simplified dynamic models have been developed, focusing on different compliant designs like bridge-type and rhombus mechanisms, though they often lack comprehensive dynamic analysis[5]. This study introduces a bridge-type compliant mechanism providing sufficient displacement amplification for piezoelectric dispensers. The entire system, including the power amplifier, compliant mechanism, dispensing port, and actuator, is modeled. The

approach uses discretization for faster calculations without compromising accuracy. Experimental validation shows the model accurately represents both static and dynamic characteristics, achieving R-squared values above 0.95 for multi-frequency inputs, demonstrating its effectiveness in predicting needle motion based on input voltage.

2- Methodology

The paper proposes a comprehensive dynamic modeling approach for a piezoelectric droplet dispenser incorporating a bridge-type compliant mechanism. The modeling method begins by decomposing the entire electromechanical system into four main components: the power amplifier, piezoelectric actuator, compliant mechanism, and fluid dispensing port. Each component is modeled individually and later coupled to predict the overall system dynamics.

a) Power Amplifier Modeling

The power amplifier, responsible for boosting the voltage signal to the piezoelectric actuator, is modeled using a firstorder dynamic equation. The model considers the bandwidth limitations imposed by the actuator's capacitance, ensuring accurate frequency response predictions. (Equation 1)

*Corresponding author's email: ghafarirad@aut.ac.ir



Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to Amirkabir University Press. The content of this article is subject to the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC 4.0) License. For more information, please visit https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

$$(RCs+1)u_o = A_u \cdot u_i(s) \tag{1}$$

b) Piezoelectric Actuator Modeling:

The actuator model uses a second-order dynamic system that accounts for mass-spring-damper properties. A significant contribution is the incorporation of a nonlinear hysteresis model based on the generalized Prandtl–Ishlinskii (PI) model. This model efficiently captures the actuator's hysteresis behavior and is identified experimentally for high accuracy without the need for force sensors. (Equation 2)

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n} w_{hi} H_{ri}[x, y_0](t) = \overrightarrow{w_h}^T \overrightarrow{H_r}[x, y_0]$$
(2)

c) Compliant Mechanism Analysis:

The bridge-type compliant mechanism, crucial for amplifying the actuator's displacement, is analytically modeled by decomposing it into 16 rigid and flexible links. Dynamic stiffness matrices are computed for each link, considering lateral vibrations, and then simplified into four equivalent links to reduce system complexity while maintaining precision. The dynamic stiffness matrix of the entire mechanism is derived, enabling accurate forcedisplacement relationships essential for coupling with other system dynamics. (Equation 3)

$$\begin{bmatrix} f_{\text{in1}} \\ f_{\text{in2}} \\ f_{\text{out}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ k_4 & k_5 & k_6 \\ k_7 & k_8 & k_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{\text{in1}} \\ u_{\text{in2}} \\ u_{\text{out}} \end{bmatrix}$$
(3)

d) Fluid Dispensing Port Modeling:

A second-order transfer function with three parameters (β 1, β 2, β 3) represents the fluid dispensing port. These parameters are identified using optimization techniques based on experimental data across multiple frequencies. (Equation 4)

$$\frac{y_d}{f_{out}} = \frac{\beta_1}{s^2 + \beta_2 s + \beta_3} \tag{4}$$

e) Coupled Dynamic Modeling:

Finally, all components are coupled into a unified dynamic model. The coupled system is represented by a comprehensive transfer function relating the needle displacement to the input voltage, incorporating frequency-dependent dynamic stiffness matrices and the identified hysteresis and fluid dispensing dynamics. (Equation 5,6)

Table 1. Results of analytical and FEM

Test Type	Analytical Model Error	FEM Error	Experimental Accuracy (R ²)
Amplification Ratio	4%	8.3%	-
Natural Frequency (Mode 1)	7%	-	-
Natural Frequency (Mode 2)	6%	-	-
Hysteresis Model Accuracy	-	-	0.99
Coupled Dynamic Model	-	-	>0.95

$$y_{d} = \frac{H_{f}(v(t))}{s^{2} + 2\xi\omega_{n}s + \omega_{n}^{2}} \cdot (k_{7}(s) + k_{8}(s) + Qk_{9}(s))$$

$$\cdot \frac{\beta_{1}}{s^{2} + \beta_{2}s + \beta_{3}}$$
(5)

$$Q = \frac{k_1(s) + k_2(s) - k_4(s) - k_5(s)}{k_6(s) - k_3(s)}$$
(6)

3- Results and Discussion

The developed model for the piezoelectric dispenser was validated through experimental tests and FEM simulations. The static analysis showed that the analytical model had an amplification ratio error of 4%, which was more accurate than the FEM model's 8.3% error. Dynamic validation revealed that the analytical model predicted natural frequencies with 7% accuracy compared to FEM results. The hysteresis model achieved an R² value of 0.99, and the overall coupled dynamic model maintained R² values above 0.95 across various test signals, proving high accuracy. (Table 1)

4- Conclusion

The study successfully developed and validated a comprehensive dynamic model for a piezoelectric droplet dispenser featuring a bridge-type compliant mechanism. The analytical approach reduced system complexity while maintaining high accuracy, with static and dynamic validations showing errors below 8% and R² values exceeding 0.94 for dynamic responses. The hysteresis model also demonstrated exceptional precision, achieving an R² of 0.99. Overall, the proposed model accurately predicts the dispenser's performance, making it highly suitable for system optimization and control design. This work offers a reliable framework for future advancements in piezoelectric dispensing technologies.



Fig. 1. Comparison between identified model and system real response

References

- [1] H. Peng, J. Deng, G. Deng, C. Zhou, J. Li, Design and Research of a Novel Piezostack-Driven Jetting Dispenser With a Diamond Spring, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 12(11) (2022) 1849-1856.
- [2] G. Li, C. Zhou, Rigid flexible coupling dynamic analysis of piezoelectric jetting dispenser based on ADAMS, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 714(3) (2021) 032081.
- [3] J. Jeon, S.-M. Hong, M. Choi, S.-B. Choi, Design and

performance evaluation of a new jetting dispenser system using two piezostack actuators, Smart Materials and Structures, 24(1) (2015) 015020.

- [4] S. Zhou, P. Yan, Design and Analysis of a Hybrid Displacement Amplifier Supporting a High-Performance Piezo Jet Dispenser, Micromachines, 14(2) (2023) 322.
- [5] G. Deng, N. Wang, C. Zhou, J. Li, A Simplified Analysis Method for the Piezo Jet Dispenser with a Diamond Amplifier, Sensors, 18(7) (2018) 2115.

نشريه مهندسي مكانيك اميركبير

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره ۵۶، شماره ۱۰، سال ۱۴۰۳، صفحات ۱۴۲۹ تا ۱۴۵۰ DOI: 10.22060/mej.2025.23611.7788

مدلسازی دینامیکی جامع و تحلیل رفتار سامانه تزریق قطره سیال به کمک پیزوالکتریک

پویا فیروزی راد، حامد غفاریراد [©] *، سید مهدی رضاعی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

خلاصه: سامانههای تزریق قطره سیال مبتنی بر پیزوالکتریک، بهعنوان دستگاههای کاربردی در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. بااین حال، ساختار الکترومکانیکی آنها اغلب پیچیدگیهایی در مدل سازی دینامیکی ایجاد می کند که ناشی از تعامل بین اجزای مختلف، بهویژه مکانیزمهای منعطف و عملگرهای پیزوالکتریک است. در این مطالعه، اجزای سیستم بهصورت جداگانه مدل سازی و با هم ترکیب شدهاند، تا رفتار سیستم پیش بینی شود. برای تحلیل مکانیزم منعطف نوع پل، روشی مناسب پیشنهاد شده تا ساختار را با حالتهای محدود مدل سازی کند. این روش میتواند رفتار اجزا را بدون کاهش دقت پیش بینی کند که آن را برای ترکیب با دینامیک سایر اجزا ایده آل می سازد. علاوه بر این، یک رویکرد مدل سازی غیرخطی معرفی شده است، تا رفتار هیسترزیس غیرخطی پیزوالکتریک را شناسایی نماید. در نهایت، با ترکیب کل دینامیک سیستم، یک مدل جامع به دست می آید. مدل توسعه یافته برای مکانیزم منعطف، بهصورت مجزا توسط نرمافزار المان محدود و آزمایش های تجربی صحهگذاری شده است، تا رفتار هیسترزیس غیر مدل هیسترزیس غیرخطی نیز شناسایی و با آزمایش های تجربی صحهگذاری شده و مقدار ضریب تعیین آن بالای ۸۹۰ محاسبه شده است. دینامیک جامع سیستم الکترومکانیکی، در فرکانس های ورودی مختلف شناسایی و آزمایش شده و مقادیر ضریب تعیین بالای مدار هی منداری خانی ماید در نهایت یکی در فرکانس های ورودی مختلف شناسایی و آزمایش شده و مقادیر ضریب محال توسعه یافته برای مدار هی بسترزیس غیرخطی نیز شناسایی و با آزمایشهای تجربی صحهگذاری شده و مقدار ضریب تعیین آن بالای ۸۹/۰ محاسبه شده موارحی و بهینه سازی دستگامهای تزریق قطره سیال پیزوالکتریک و همچنین در طراحی سیستمههای کنترلی کاربردی است.

تاریخچه داوری: دریافت: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ارائه آنلاین: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

کلمات کلیدی: سامانه تزریق قطره سیال پیزوالکتریک مدلسازی دینامیکی مکانیزم منعطف هیسترزیس

۱ – مقدمه

سامانههای تزریق قطره سیال مبتنی بر پیزوالکتریک به دلیل دقت، وضوح و سرعت استثناییشان در صنایع مختلف کاربرد گستردهای دارند[۱–۳]. مدلسازی این ساختارها به دلیل وجود قسمتهای متعدد میتوانند بسیار پیچیده باشند. بسیاری از منابع و همچنین آزمایشها عملی نشان میدهند که خود عملگر پیزوالکتریک به تنهایی قابلیت تامین جابهجایی مورد نیاز برای دستگاه تزریق را ندارد. [۴, ۵] به همین دلیل چندین راهحل برای افزایش میزان جابهجایی عملگر وجود دارد که در ادامه مورد برسی قرار میگیرند.

مطالعات متعددی در زمینه توسعه و مدل سازی دستگاههای تزریق مبتنی بر پیزوالکتریک و سیستمهای تقویت دامنه این سامانه انجام شده است. برخی از این مطالعات از سیستم اهرمی – لولایی برای تقویت دامنه

پیزوالکتریک استفاده کردهاند[۶–۱۲]. اگرچه این مکانیزم برای طراحی و مدلسازی نسبتاً ساده است، اما محدودیتهایی نیز دارد. بهعنوان مثال، مسیر حرکت سوزن منحنی است که میتواند منجر به عدم هم مرکزی سوزن با نازل و یا مشکلات تنظیم در سیستم تزریق شود.

علاوه بر این، این مکانیزم گاهی به دو عملگر پیزوالکتریک نیاز دارد که ممکن است از نظر اقتصادی پر هزینه و از نظر کنترل پیچیدهتر باشد. همچنین، در این ساختارها عملگر پیزوالکتریک تحت خمش قرار میگیرد که میتواند عمر عملگر را کوتاه کند. در زمینه مدلسازی دستگاههای تزریق که این مکانیزم را شامل میشود، پنگ و همکاران[۶, ۷] از نرمافزار ادمز^۱ برای شبیهسازی دینامیک مکانیزم استفاده کردند. در پژوهشی دیگر دنگ و همکاران [۸] از نرمافزار سیمیولیشن ایکس^۲ برای شبیهسازی سیستم استفاده

Creative Commons License) حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است. این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی (Creative Commons License) (Creative Commons License) در دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دیدن فرمائید.

^{*} نویسنده عهدهدار مکاتبات: ghafarirad@aut.ac.ir

ADAMS
 SimulationX

کردند، جئون و همکاران [۹] از نرمافزار انسیس ٔ برای شبیهسازی حرکت سوزن بهره بردند. اگرچه نرمافزارهای شبیهسازی تجاری میتوانند دقیق و ساده باشند، اما هزینههای بالای محاسباتی و زمان اجرای طولانی آنها باعث میشود که کمتر در بهینهسازی، شناسایی و طراحیهای کنترولر مبتنی بر مدل کاربرد داشته باشند.

ژو و همکاران، کائو و همکاران، و ژائو و همکاران [۱۲–۱۴] دینامیک دستگاه تزریق پیزوالکتریک دوتایی را با مکانیزم تقویت اهرمی مدلسازی کردند. این مدل شامل معادلات خطی درجه دو برای توصیف حرکت سیستم اهرمی است و رفتار غیرخطی عملگر پیزوالکتریک نادیده گرفته شده است.

چندین مطالعه اخیر استفاده از مکانیزمهای منعطف[۱, ۴, ۱۵, ۱۶] را بهعنوان جایگزینی برای طراحیهای اهرمی-لولایی بررسی کردهاند. مکانیزمهای منعطف، ساختارهایی هستند که از انعطاف پذیری ساختار خاص خود برای تقویت جابهجایی پیزوالکتریک استفاده میکنند[۱۷–۱۹]. در حالی که مکانیزمهای منعطف پتانسیل رفع برخی محدودیتهای مکانیزم اهرمی را دارند، اما طراحی و مدلسازی آنها نیز چالشبرانگیزتر است. یک روش مکانیزم منعطف نوع پل جهت طراحی یک دستگاه تزریق پیزوالکتریک توسعه داده شده است. این روش تحلیلی تنها برای بهینهسازی یک مکانیزم منعطف نوع پل استفاده شد تا سیستمی با پهنای باند بالا را به ارمغان آورد. در مقاله دیگری، آنها همچنین روشی ساده برای محاسبه نسبت تقویت یک مکانیزم لوزی شکل مورد استفاده در دستگاه تزریق پیزوالکتریک پیشنهاد

دنگ و همکاران [۱۶] از یک روش ساده شده برای مدلسازی رفتار دینامیکی یک دستگاه تزریق که شامل یک مکانیزم منعطف نوع لوزی است، استفاده کردند. روش آن ها مبتنی بر یک جرم-فنر-میراگر معادل برای پیزوالکتریک و مکانیزم منعطف بود و نتایج آن ها با شبیه سازی المان محدود مقایسه گردیده است. همچنین، لو و همکاران [۱] فرآیند تولید قطره و حجم قطره را برای یک دستگاه تزریق پیزوالکتریک با تقویت کننده مکانیزم لوزی شبیه سازی کردند، اما هیچ تحقیقی در مورد رفتار دینامیکی سیستم انجام نشده است. بو و همکاران [۲۰] یک مکانیزم تقویت کننده دامنه جدید را پیشنهاد کردند که از یک مکانیزم اهرمی با یک لینک منعطف به جای لولاهای معمولی استفاده می کند. این مکانیزم توسط دو عملگر پیزوالکتریک

مکانیزم توسعه داده شده است. وو و همکاران [۲۱] دستگاه تزریقی مبتنی پیزوالکتریک با یک مکانیزم منعطف نوع ۲ال^۲ پیشنهاد دادند و از یک روش تحلیلی ساده برای محاسبه نسبت تقویت و تنش ناشی از مکانیزم استفاده کردند. دینامیک کامل سیستم در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت.

باتوجهبه منابع ذکر شده، مطالعه کافی در مورد دینامیک جامع دستگاههای تزریق پیزوالکتریک وجود ندارد که دینامیک پیچیده مکانیزمهای منعطف را در حضور نیروهای خارجی مدلسازی کند و رفتار غیرخطی عملگرهای پیزوالکتریک را نیز در نظر بگیرد. مدلهای پیشنهادی در منابع موجود یا بهقدری سادهسازی شدهاند که قادر به توصیف دقیق حرکت سیستم در فرکانسهای بالا نیستند یا مبتنی بر شبیهسازیهای نرمافزاری هستند که بهاندازه کافی سریع و کاربردی برای استفاده در شناسایی سیستم، بهینهسازی، یا طراحیهای سیستم کنترلی نیستند.

این مطالعه یک مکانیزم منعطف نوع پل را معرفی مینماید که جابهجایی عملگر پیزو را به میزانی تقویت مینماید که برای دستگاه تزریق قطره سیال مناسب گردد. علاوه بر این، تمام اجزای سیستم در این پژوهش مدلسازی شدهاند که شامل درایور، مکانیزم منعطف، درگاه تزریق، و عملگر پیزوالکتریک می باشد. برای این منظور از یک مدل دینامیک درجه اول برای دینامیک درایور پیزو استفاده شده است. سپس، یک مدل غیرخطی برای عملگر پیزوالکتریک مورد استفاده قرار گرفته است که رفتار هیسترزیس عملگر را در نظر می گیرد. دینامیک بعدی مربوط به مکانیزم منعطف نوع پل است که تأثیر قابل توجهی بر رفتار سیستم دارد. این پژوهش در این زمینه یک رویکرد تحلیلی را توسعه میدهد، که بر مبنای گسستهسازی کل مکانیزم به بخشهای منعطف و صلب است. برای این که بتوان دینامیک را از حالت بسیار پیچیده خارج نمود یک روش ابداع شده است که المان های بههم پیوسته را با یکدیگر ترکیب نموده و المان معادل برای سیستم استخراج مینماید. در این روش تعداد حالتهای سیستم به شدت کاهش می یابد و پس از اعمال روش کاهشی دیگر، یک دینامیک تک ورودی و تک خروجی به ارمغان میآورد که کار را برای شناسایی و بهینهسازی طراحی بسیار آسان تر مینماید. این دینامیک بهسادگی به دینامیکهای بالادستی و پاییندستی متصل می شود و در نهایت یک تابع تبدیل برای کل سیستم به دست می آید. در ادامه جهت صحه گذاری مدل های پیشنهادی، یک دستگاه تزریق

سیال مبتنی بر پیزوالکتریک طراحی و ساخته شده است که از مکانیزم تقویت دامنه پل بهره میبرد. بر اساس مدل ساخته شده، ضرایب مجهول مدل



شکل ۱. ساختار سیستم تزیق قطره سیال طراحی شده و اجزای آن

Fig. 1. Structure of the designed fluid droplet dispensing system and its components

دینامیک و همچنین رفتار غیرخطی پیزو به دست آمدهاند. بخشهای اساسی سیستم با مدل توسعهیافته و همچنین مدلسازی نرمافزاری با انسیس مقایسه شده و مورد صحهگذاری قرار گرفتهاند که در بخش رفتار دینامیکی و استاتیکی سیستم نشان از خطای کمتر از ۸٪ دارند. مدلهای شناسایی شده برای رفتار غیرخطی هیسترزیس دارای ضریب تعیین بالای ۹۸/۰ است و برای مدل دینامیکی کل سیستم نیز که در فرکانسهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است دارای ضریب تعیین بالای ۹۵/۰ است که نشان از همخوانی مناسب بین دادههای تجربی و مدلسازی است.

۲ – ساختار دستگاه تزریق قطره سیال

پیکربندی کلی دستگاه تزریق در شکل ۱ نشان داده شده است. سیستم تزریق بدین صورت عمل مینماید که در هر بار حرکت رفت و برگشتی سوزن مقدار بسیار کمی از سیال به بیرون پرتاب میشود که تشکیل یک قطره واحد را میدهد . حرکت سوزن توسط یک عملگر پیزوالکتریک تامین میگردد که به تنهایی جابجایی قابل توجهی ندارد (۴۲ میکرومتر) برای رفع این محدودیت از یک مکانیزم تقویت دامنه نوع پل کمک گرفته شده است که میتواند خروجی را تا چندین برابر تقویت نماید. ساختار مکانیزم منعطف

نوع پل در شکل ۱ نشان داده شده است..

مکانیزم منعطف به گونهای طراحی شده است که عملگر پیزوالکتریک را در بر بگیرد و جابهجایی آن را از طریق پورتهای ورودی جذب کند. پورت بالایی مکانیزم منعطف به قاب دستگاه ثابت شده است و به مکانیزم اجازه میدهد تا کل جابهجایی را به بخش پایین منتقل کند. بخش پایین مکانیزم منعطف مستقیماً به سوزن متصل میباشد و درواقع حرکت پیزو به واسطه مکانیزم منعطف به سوزن منتقل می گردد.

۳- مدلسازی دینامیک کل سیستم

مدلسازی سیستمهای مبتنی بر پیزوالکتریک به دلیل تعامل پیچیده بین جنبههای الکتریکی و مکانیکی آنها و همچنین رفتار غیرخطی ذاتی آنها عملی چالشبرانگیز است به همین سبب برای کاهش این پیچیدگی، سیستم به اجزای مجزا تقسیم میشود که در شکل ۲ نشان داده شده است. این اجزا شامل درایور پیزو، عملگر پیزوالکتریک، مکانیزم منعطف و درگاه تزریق، میباشد. این تقسیمبندی سیستم، تجزیه و تحلیل مؤثر دینامیک پیچیده کل سیستم را امکانپذیر میسازد. در این بخش، تمام دینامیکهای ذکر شده به ترتیب بررسی میشوند و در نهایت همه آنها به هم متصل میگردند.



شکل ۲. بلوک دیاگرام ارتباط اجزای سیستم شامل درایور پیزوالکتریک، عملگر پیزو الکتریک، مکانیزم منعطف و درگاه تزریق

Fig. 2. Block diagram of the system component's connections, including the piezoelectric driver, piezoelectric actuator, flexible mechanism, and injection port

۳– ۱– ديناميک درايور پيزو

درایور پیزوالکتریک بهعنوان یک جزء در سیستمهای مبتنی بر پیزوالکتریک اهمیت زیادی دارد. درایور پیزوالکتریک وظیفه افزایش ولتاژ سیگنالهای آنالوگ تولید شده توسط سیستمهای دیجیتال به آنالوگ را دارد تا ولتاژ موردنیاز برای عملگر پیزوالکتریک را تأمین کند. بااینحال، ضروری است که توجه شود که ظرفیت خازنی عملگر پیزوالکتریک محدودیتی بر پهنای باند دینامیک تحمیل میکند. در این زمینه، یک مدل دینامیکی درجه اول میتواند اثر درایور پیزوالکتریک را مدلسازی نماید، این مدل در معادله (۱) بیان شده است[۲۲].

$$(RCs+1)u_{a} = A_{\mu} \cdot u_{i}(s) \tag{1}$$

در اینجا، C نشان دهنده مقدار ظرفیت خازنی پیزوالکتریک است، R و R بن اینجا، C نشان در ایور پیزوالکتریک A_u به ترتیب مقاومت الکتریکی و نسبت تقویت ولتاژ درایور پیزوالکتریک را نشان می دهند.

۳- ۲- عملگر پيزوالكتريك

عملگر پیزوالکتریک نقش تولید جابهجایی مورد نیاز سیستم را دارد و این جابهجایی را به مکانیزم منعطف منتقل می کند. مدل سازی دینامیک عملگرهای پیزوالکتریک معمولاً شامل رفتار غیرخطی است که باید در رفتار سیستم لحاظ گردد.

برای مدلسازی دقیق رفتار عملگرهای پیزوالکتریک، یک مدل دینامیک درجه دوم به کاررفته است. این مدل به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول یک مدل دینامیک خطی است که شامل سیستم جرم – فنر – میراگر است. بخش دوم غیر خطی بودن عملگر، به ویژه اثر هیسترزیس را در نظر می گیرد[۲۳].

معادله حاکم بر پیزوالکتریک به صورت زیر است:

$$\ddot{x}(t) + 2\xi \omega_n \dot{x}(t) + \omega_n^2 x(t) = H_f(v(t)) \tag{(Y)}$$

و به ترتیب جابهجایی عملگر و ولتاژ ورودی را نشان میدهند. ضریب

میرایی و فرکانس طبیعی سیستم دینامیک خطی به ترتیب با کخ و ω_n نشان داده می شوند. عبارت $H_f(v(t))$ برای توصیف رابطه هیسترزیس بین ولتاژ ورودی و نیروی تحریک است.

عبارت $H_f(v(t))$ نیروی معادل پیزوالکتریک در تعامل با نیروهای خارجی اعمال شده به عملگر است که میتواند بهصورت زیر بیان شود:

$$H_f(v(t)) = F(v(t)) - F_e \tag{(7)}$$

که در آن F(v(t)) نیروی داخلی پیزوالکتریک و F_e نیروی خارجی است. عملگر پیزوالکتریک به دلیل سختی بالای خود، فرکانس طبیعی بسیار بالایی دارد. بنابراین، جمله لختی و میرایی در فرکانسهای پایین ناچیز میشوند و میتوان آنها را نادیده گرفت. شایان ذکر است که فرکانس عملیاتی دستگاه کمتر از ۱ کیلوهرتز است که بهطور قابل توجهی کمتر از فرکانس طبیعی پیزوالکتریک (۴۲ کیلوهرتز) است. بنابراین معادله به صورت زیر خواهد بود[۲۴]:

$$x(t) = \frac{1}{\omega_n^2} H_f(v(t)) = H_x(v(t))$$

$$\{ \ddot{x}(t) \ll 2\xi \omega_n \dot{x}(t) \ll \omega_n^2 x(t) \}$$
(6)

این معادله ارتباط بین ولتاژ ورودی و جابهجایی عملگر را برقرار می کند. مزیت این رویکرد این است که رابطه غیرخطی بین ولتاژ ورودی و جابهجایی را شناسایی می کند، نه بین ولتاژ ورودی و نیروی تحریک. بنابراین، نیازی به سنسور نیرو نیست، زیرا سنسور موقعیت عملگر میتواند سیگنالهای موقعیت لازم را گزارش نماید. پس از شناسایی رفتار هیسترزیس با دادههای تجربی مربوطه، با ضرب خروجی تابع هیسترزیس در ω_n^2 نیروی خروجی عملگر به دست میآید.

نیروی تولید شده توسط ساختار پیزوالکتریک است. نیروی $H_f(v(t))$ تولید شده توسط ساختار پیزوالکتریک است. نیروی تولید شده توسط پیزو الکتریک در واقع یک نگاشت از ولتاژ ورودی به نیروی خام ایجاد شده توسط آن است. این نیرو به ساختار عملگر پیزوالکتریک وارد می شود و در نهایتا جابجایی خروجی پیزو ایجاد می شود. برای ساختار بدنه پیزو یک دینامیک خطی مرتبه اول همچون معادله ۵ در نظر گرفته می شود.

$$\ddot{x}(t) + 2\xi \omega_n \dot{x}(t) + \omega_n^2 x(t) =$$

$$H_f(v(t)) = \omega_n^2 H_x(v(t))$$
(Δ)

که در آن $H_x(v(t))$ ، \mathcal{Z} و \mathcal{O}_n قابل شناسایی توسط دادههای تجربی هستند.

۳ –۳ – مدلسازی رفتار هیسترزیس

سازوکارهای هیسترزیس پدیدههای غیرخطی هستند که معمولاً در بسیاری از سیستمهای فیزیکی یافت میشوند. مدلهای متعددی برای توصیف رفتار این حلقهها پیشنهاد شده است که در میان آنها، مدل پرندتل ایشلینسکی (PI) برای استفاده در این مطالعه انتخاب شده است[۲۵]. این مدل به دلیل سادگی و قابلیت معکوس پذیری آن، بهویژه برای طراحی سیستمهای کنترلی مناسب است. مدل IP متشکل از مجموعهای از عملگرها است که هرکدام نمایانگر یک حلقه هیسترزیس خاص هستند. با ترکیب خطی این عملگرها، میتوان طیف وسیعی از حلقههای هیسترزیس را شبیه سازی کرد. یکی از عملگرهای کلیدی در مدل IP، تابع لقی است که معمولاً برای مدل سازی لقی دندههای درگیر استفاده میشود. این تابع یک مدل تک عملگری است که میتواند برای توصیف دامنه وسیعی از حلقههای هیسترزیس استفاده شود[۲۵].

$$y(t) = H_r[x, y_0](t) = max[x(t) - r, min\{x(t) + y(t - T)\}]$$
(5)

ورودی و خروجی کنترلی به ترتیب با X و Y نشان داده شدهاند. ولتاژ تحریک عملگر به عنوان ورودی کنترل در نظر گرفته می شود، در حالی که جابه جایی عملگر به عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته می شود. مقدار T همواره مثبت است که نشان دهنده میزان لقی سیستم است. مقدار اولیه خروجی سیستم با y_0 نشان داده می شود، در حالی که T دوره نمونه برداری را نشان می دهد.

با ضرب کردن عملگر H_r در ضریب وزنی w_h ، عملگرلقی عمومی بهدست میآید[۲۳].

$$y(t) = w_h H_r[x, y_0](t)$$
 (Y)



شکل ۳. آرایش المانها در مکانیزم منعطف پل

Fig. 3. Arrangement of elements in the bridge flexible mechanism

همان طور که قبلاً بیان شد برای اطمینان از اینکه مدل PI می تواند با هر مدل هیسترزیس کار کند، باید به صورت مجموعی از توابع وزنی بیان شود، که درنتیجه معادله (۷) را به صورت زیر تغییر می یابد[۲۳]:

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n} W_{hi} H_{ri}[x, y_0](t) =$$

$$\overrightarrow{w_h}^T \overrightarrow{H_r}[x, y_0]$$
(A)

شناسایی حلقههای نامتقارن میتواند با استفاده از مدل اصلاح شده پرندتل ایشلینسکی تسهیل شود. این مدل شامل جایگزینی یک تابع اشباع در مدل عمومی PI است که در معادله (۹) توصیف شده است. مدل اصلاح شده به این ترتیب نمایشی دقیق تر و تفصیلی تر از پدیده حلقه نامتقارن ارائه می دهد.

$$S_{d}[x](t) = \begin{cases} \max\{x - d, 0\} & \text{if } d > 0 \\ 0 & \text{if } d = 0 \end{cases}$$
(9)

$$d = (i-1) \times \frac{K}{m-1} \tag{(1)}$$

با این کار، مدل PI اصلاحشده به دست می آید که به صورت زیر[۲۳]:

$$y(t) = \sum_{i=1}^{m} w_{si} S_d[x](t) = \overrightarrow{w_s}^T \overrightarrow{S_d}[x](t)$$
(11)

برای شناسایی مؤثر سیستم، ضروری است که ضرایب W_{hi} و W_{si} با استفاده از روش شناسایی سیستم بهدست آید. انتخاب m و n باید بر اساس رفتار سیستم باشد. افزایش n منجر به اضافه شدن تعداد توابع وزنی می شود که در نتیجه منجر به تطبیق نرمتر مدل می شود. از سوی دیگر، افزایش m امکان شناسایی حلقه نامتقارن را فراهم می آورد و مدل را قادر می سازد تا پیش بینی بهتری از مورد سیستمهای هیسترزیس نامتقارن انجام دهد.

معادله (۱۱) یک نگاشت غیرخطی بین ورودی و خروجی را ارائه میدهد. جایگزینی X و Y با u_0 و $H_x(u_0)$ که ولتاژ ورودی و جابهجایی خروجی عملگر است، رفتار هیسترزیس عملگر را مدل سازی می نماید.

۳- ۴- مدل دینامیک مکانیزم منعطف

هندسه مکانیزم منعطف در شکل ۳ نشان داده شده است. قسمت زرد رنگ نشان دهنده عملگر پیزوالکتریک است که در اثر اعمال ولتاژ افزایش طول میدهد. برای اجرای روش تحلیلی توسعهیافته، ابتدا باید مکانیزم به ۱۶ لینک تقسیم شود، همان طور که در شکل ۳ نشان داده شده است. پیکربندی المانها به طور عمدی به این شکل انتخاب شده است تا فرآیند گرفتن لینکهای معادل در مراحل بعدی آسان تر شود.

پورتهای ورودی و خروجی مکانیزم به عنوان جرمهای متراکم فرض می شوند و جرم لینکهای منعطف نادیده گرفته می شود. همان طور که در شکل ۴ نشان داده شده است، هر المان دارای دو گره k و j با سه درجه آزادی در هر گره است.

(i = 1, 2, 3, ..., 16) ماتریس سفتی دینامیکی برای المان أم



شکل ۴. دیاگرام آزاد المان منعطف در مکانیزم پل



می تواند به صورت زیر نوشته شود[۲۲] :

$$\begin{cases} d_{1} = \frac{EA\alpha \cot(\alpha)}{l} \\ d_{2} = \frac{EI\beta^{3} \left(\cos\beta\sinh\beta + \sin\beta\cosh\beta\right)}{Rl^{3}} \\ d_{3} = -\frac{EI\beta^{2} \left(\sin\beta\sinh\beta\right)}{Rl^{2}} \\ d_{4} = \frac{EI\beta \left(\sin\beta\cosh\beta - \cos\beta\sinh\beta\right)}{Rl} \\ d_{5} = -\frac{EA\alpha\csc(\alpha)}{l} \\ \frac{EI\beta^{3} \left(\sin\beta + \sinh\beta\right)}{Rl} \end{cases}$$
(17)

$$d_{6} = -\frac{EI\beta^{2}(\sin\beta + \sinh\beta)}{Rl^{3}}$$
$$d_{7} = \frac{EI\beta^{2}(\cosh\beta - \cos\beta)}{Rl^{2}}$$
$$d_{8} = \frac{EI\beta(\sinh\beta - \sin\beta)}{Rl}$$

 $w_e(\omega) = D_e(\omega)u_e(\omega) =$

$$\begin{bmatrix} d_{1} & 0 & 0 & d_{5} & 0 & 0 \\ 0 & d_{2} & -d_{3} & 0 & d_{6} & d_{7} \\ 0 & -d_{3} & d_{4} & 0 & -d_{7} & d_{8} \\ d_{5} & 0 & 0 & d_{1} & 0 & 0 \\ 0 & d_{6} & -d_{7} & 0 & d_{2} & d_{3} \\ 0 & d_{7} & 0 & 0 & d_{3} & d_{4} \end{bmatrix} u_{e}(\omega)$$
(17)

که در آن $W_e(\omega)$ و $W_e(\omega)$ به ترتیب بردارهای نیروی ۳×۱ و جابهجایی هستند و $D_e(\omega)$ ماتریس سفتی دینامیکی است. اندیس e نشان دهنده انتساب متغیر به یک المان است و ω فرکانس سیستم است که معادلات را به محیط فرکانس میبرد. d_1 ا d_8 ضرایبی هستند که از معادله ارتعاش جانبی یک المان تیر مشتق شدهاند که به مرجع [۱۷] ارجاع داده می شوند.

$$\alpha^{2} = \frac{\omega^{2}I^{2}\rho}{E}, \quad \beta^{4} = \frac{\omega^{2}I^{2}\rho A}{EI}, \quad (1\%)$$
$$R = 1 - \cos\beta\cosh\beta$$

A و I به ترتیب نشاندهنده مساحت و ممان اینرسی مقطع یک تیر منعطف هستند I و ρ به ترتیب طول، مدول یانگ و چگالی جرم تیر را نشان میدهند. المانهای ۱، ۵، ۱۲ و به دلیل ضخامت بیشتر آنها، انعطاف پذیری شان نادیده گرفته شود. معادله (۱۲) می تواند به صورت زیر نوشته شود[۲۲]:

$$\begin{bmatrix} w_{ij}(\omega) \\ w_{ik}(\omega) \end{bmatrix} = D_i(\omega) \begin{bmatrix} u_{ij} \\ u_{ik} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k'_{i1} & k'_{i2} \\ k'_{i3} & k'_{i4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{ij} \\ u_{ik} \end{bmatrix}$$
(10)

که در آن u_{ij} و u_{ij} بردارهای جابهجایی در j و k هستند که گرههای دو انتهای تیر را تعریف میکنند، همان طور که در شکل ۴ نشان داده شده است. k'_{i2} , k'_{i2} , k'_{i3} و k'_{i4} ماتریسهای بلوکی تشکیل دهنده ماتریس $D_i(\omega)$ در دستگاه مختصات جهانی هستند که از $D_i(\omega)$ محلی به دست میآید. ماتریس سفتی دینامیکی در دستگاه محلی با استفاده از ماتریس دوران اشاره شده در معادله زیر میتواند به دستگاه مختصات جهانی منتقل شود.

$$D_i(\omega) = R_i^T \cdot D^e(\omega) \cdot R_i \tag{19}$$

$$R_{i} = \begin{bmatrix} T_{i} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & T_{i} \end{bmatrix}, \quad T_{i} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(1Y)

$$u_{ij} = \begin{bmatrix} u_{ij} \\ v_{ij} \\ \theta_{ij} \end{bmatrix}, \quad w_{ij} = \begin{bmatrix} F_{ij} \\ V_{ij} \\ M_{ij} \end{bmatrix}$$
(1A)

 v_{ij} ، v_{ij} و v_{ij} که بهترتیب جابهجایی در جهات افقی و عمودی و چرفت در گره و V_{ij} ، u_{ij} بهترتیب نیروها پرخش در گره j و j بهترتیب نیروها در جهات افقی و عمودی و M_{ij} به ممان در گره مربوطه اشاره دارد. معادله حرکت در معادله (۱۹) نوشته شود که در آن

نیروی ورودی و جابهجایی برای یک گره، هر دو در سمت چپ معادله قرار دارند.

$$\begin{bmatrix} u_{ik} \\ -w_{ik} \end{bmatrix} = T_i \begin{bmatrix} u_{ij} \\ w_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{i1} & t_{i2} \\ t_{i3} & t_{i4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{ij} \\ w_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_{i2}^{\prime-1} \cdot k_{i1}^{\prime} & k_{i2}^{\prime-1} \\ k_{i4}^{\prime} \cdot k_{i2}^{\prime-1} \cdot k_{i1}^{\prime} - k_{i3}^{\prime} & -k_{i4}^{\prime} \cdot k_{i2}^{\prime-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{ij} \\ w_{ij} \end{bmatrix}$$
(19)

 T_i ماتریس جدیدی است که از بازآرایی معادله بهدست آمده است تا به شکل نیروی ورودی-جابهجایی باشد t_{i1} ، t_{i2} ، t_{i1} زیرماتریسهای شکل نیروی ورودی-جابهجایی باشد t_{i1} ، t_{i2} ، t_{i3} زیرماتریسهای بلوکی T_i هستند. همان طور که در شکل ۵ نشان داده شده است، لینکهای سری متصل به پورتهای ورودی به خروجی یا زمین میتوانند به یک لینک واحد تبدیل شوند که با ضرب ماتریسهای سختی بازآرایی شده آنها در معادله (۱۹) بهدست میآوانند به عبارت دیگر، ۱۶ لینک مکانیزم میتوانند به ۴ لینک معادله را ا

$$\begin{cases} T^{1} = T_{4} \cdot T_{3} \cdot T_{2} \cdot T_{1} \\ T^{2} = T_{8} \cdot T_{7} \cdot T_{6} \cdot T_{5} \\ T^{3} = T_{12} \cdot T_{11} \cdot T_{10} \cdot T_{9} \\ T^{4} = T_{16} \cdot T_{15} \cdot T_{14} \cdot T_{13} \end{cases}$$
(Y ·)

$$\begin{bmatrix} w_{ij} \\ w_{ik} \end{bmatrix} = D_i (\omega) \begin{bmatrix} u_{ij} \\ u_{ik} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k'_{i1} & k'_{i2'} \\ k'_{i3} & k'_{i4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{ij} \\ u_{ik} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t_{i2}^{-1} \cdot t_{i1} & t_{i2}^{-1} \\ t_{i4} \cdot t_{i2}^{-1} \cdot t_{i1} - t_{i3} & -t_{i4} \cdot t_{i2}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{ij} \\ u_{ik} \end{bmatrix}$$
(Y1)

که i از ۱ تا ۴ شمارش می شود. پس از به دست آوردن تمام ماتریس های سختی، بر اساس اصل دلامبر، تعادل نیروهای پورتهای ورودی و خروجی به صورت زیر است:



شکل ۵. المان معادل در مکانیزم منعطف پل

Fig. 5. Equivalent element in the bridge flexible mechanism

ماتریس سفتی دینامیکی مشتق شده از معادله (۲۴) یک ماتریس ۹×۹ با ۹ حالت است. از بین این حالات، تنها سه حالت فعال هستند که شامل نیروها و جابهجاییهای افقی در پورتهای ورودی، و همچنین نیروها و جابهجاییهای عمودی در پورتهای خروجی می شوند. برای حذف حالات غیر ضروری، ستون ها و ردیف هایی که با سه حالت فعال همبستهاند، در گوشه بالا سمت چپ ماتریس جمع آوری می شوند. با جایگزینی مکان های ستون ها و ردیف ها، معادله حاصل به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{bmatrix} f_{in1} \\ f_{in2} \\ f_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{1(3\times3)} & K_{2(3\times6)} \\ K_{3(6\times3)} & K_{4(6\times6)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{in1} \\ u_{in2} \\ u_{out} \\ U_{6\times1} \end{bmatrix}$$
(Y Δ)

که در آن $K_{1(3\times 3)}$ ، $K_{3(3\times 3)}$ ، $K_{2(3\times 3)}$ ، $K_{1(3\times 3)}$ زیرماتریسهای بلوکی هستند که با جابجایی ردیفها و ستونهای ماتریس اصلی بهدست آمدهاند. با توجه به معادله (۲۵) می توان بهراحتی بهدست آورد:

$$\begin{bmatrix} f_{\text{in1}} \\ f_{\text{in2}} \\ f_{\text{out}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{1(3\times3)} - K_{2(3\times6)} \cdot K_{4}^{-1} & K_{3(6\times3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{\text{in1}} \\ u_{\text{in2}} \\ u_{\text{out}} \end{bmatrix}$$
(78)
+ $K_{2(3\times6)} \cdot K_{4}^{-1} & K_{4}^{-1} & K_{3(6\times6)} \cdot K_{3(6\times3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{\text{in1}} \\ u_{\text{in2}} \\ u_{\text{out}} \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} f_{\text{in1}} = w_{1j} + w_{4k} + M_1 u_{\text{in1}} \\ f_{\text{in2}} = w_{2j} + w_{3k} + M_1 u_{\text{in2}} \\ f_{\text{out}} = w_{1k} + w_{2k} + M_2 u_{\text{out}} \end{cases}$$
(YY)

که در آن $f_{\rm in1}$ و $f_{\rm in2}$ نیروی ورودی به پورتها ورودی و $f_{\rm in1}$ نیرو در پورتها ورودی و M_2 ماتریسهای جرم پورتهای در پورت خروجی مکانیزم است. M_1 و M_1 ماتریسهای جرم پورتهای ورودی و خروجی هستند که از معادله (۲۳) به دست آمده اند [۲۲].

$$\begin{cases} f_{in1} = w_{1j} + w_{4k} + M_1 u_{in1} \\ f_{in2} = w_{2j} + w_{3k} + M_1 u_{in2} \\ f_{out} = w_{1k} + w_{2k} + M_2 u_{out} \end{cases}$$
(YP)

با جایگزینی معادله (۲۱) در معادله (۲۲)، مدل سختی دینامیک عمومی دو پورت مکانیزم میتواند در نهایت به صورت یک شکل واحد به صورت معادله (۲۴) بیان شود.

$$\begin{bmatrix} f_{in1} \\ f_{in2} \\ f_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11'} + k_{44'} & 0 & k_{12'} \\ + M_1 & & & \\ 0 & k_{21'} + k_{34'} & k_{22'} \\ + M_1 & & & \\ k_{13'} & k_{23'} & k_{14'} + k_{24'} \\ k_{13'} & k_{23'} & + M_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{in1} \\ u_{in2} \\ u_{out} \end{bmatrix}$$
(Yf)

حساب کردن ماتریس نهایی سختی دینامیکی و نامگذاری المانها آن از
یا
$$k_9$$
 باعث میشود معادله حرکت بهصورت معادله (۲۷) بهدست آید.

$$\begin{bmatrix} f_{\text{in1}} \\ f_{\text{in2}} \\ f_{\text{out}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ k_4 & k_5 & k_6 \\ k_7 & k_8 & k_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{\text{in1}} \\ u_{\text{in2}} \\ u_{\text{out}} \end{bmatrix}$$
(YY)

۳– ۵– دینامیک درگاه تزریق سیال

هنگام تحلیل دینامیک یک سیستم تزریق، مهم است که نیروی متقابل ایجاد شده توسط سیال در محفظه تزریق و بوش راهنما و آببند را در نظر بگیریم. برای دستیابی به یک نمای دقیق از رفتار دینامیکی فرایند تزریق، یک تابع تبدیل درجه دوم با دو قطب (معادله (۲۸)) پیشنهاد شده است. با استفاده از تکنیکهای بهینهسازی، ضرایب تابع تبدیل، که با β_1 ، β_2 و β_3 نشان داده میشوند، میتوانند به طور دقیق شناسایی شوند تا با نتایج آزمایشهای تجربی انجامشده تحت فرکانسها و شرایط مختلف مشابه شوند.

$$\frac{y_d}{f_{out}} = \frac{\beta_1}{s^2 + \beta_2 s + \beta_3} \tag{YA}$$

۳- ۶- دینامیک جامع سیستم

معادله دینامیک برای مکانیزم منعطف را می توان در معادله (۲۷) یافت. در این معادله، $u_{in1} = u_{in1}$ به همان نیروهایی که از معادله (۵) بهدست آمدهاند، اشاره دارند، همچنین f_{out} نمایانگر نیروی منتقل شده به سوزن است. مقادیر k_1 تا k_2 در معادله (۲۷) تابع w هستند که نمایانگر فرکانس است. برای تبدیل معادله به فضایی فرکانسی، نیاز است که sj = -(S) در آن S عملگر لاپلاس و j عدد موهومی است) جایگزین w شود.

با ترکیب تمام دینامیکهای سیستم، یک تابع تبدیل جامع می تواند همانند معادله (۲۹) و معادله (۳۰) بهدست آید که جابه جایی سوزن دستگاه تزریق را نسبت به ولتاژ ورودی سیستم محاسبه می کند.

$$y_{d} = \frac{H_{f}(v(t))}{s^{2} + 2\xi\omega_{n}s + \omega_{n}^{2}}$$

$$\cdot (k_{\gamma}(s) + k_{g}(s) + Qk_{g}(s))$$

$$\cdot \frac{\beta_{1}}{s^{2} + \beta_{2}s + \beta_{3}}$$
 (Y9)

$$Q = \frac{k_1(s) + k_2(s) - k_4(s) - k_5(s)}{k_6(s) - k_3(s)}$$
(°·)

۴- آزمایش تجربی و نتایج

یک چینش آزمایشی برای صحه گذاری روش های تحلیلی طراحی شده است، همان طور که در شکل ۶ نشان داده شده است.

این چینش شامل چندین جزء است، از جمله یک مکانیزم منعطف که دارای یک استک پیزوالکتریک است. خواص هندسی مکانیزم در جدول ۱ نشان داده شده است که به پارامترهای شکل ۳ اشاره دارد .

کنترل ستاپ با استفاده از نرمافزار متلب سیمیولینک انجام می پذیرد. به این صورت که این نرمافزار مستقیماً با کارت دادهبرداری در ارتباط است که قابلیت تولید و دریافت سیگنالهای آنالوگ را دارد. همچنین سیگنال ورودی پیزو قبل از رسیدن به عملگر پیزوالکتریک، توسط یک درایور پیزوالکتریک تقویت می شود.

برای گزارش حرکت دقیق سوزن، یک حسگر نوری استفاده می شود که دادههای موقعیت را به صورت بلادرنگ از طریق کارت داده برداری به کامپیوتر ارسال می کند.

همچنین برای عملکرد مؤثر دستگاه تزریق یک منبع فشار نئوماتیک موردنیاز است. برای این منظور یک کمپرسور هوا به کار گرفته شده است و فشار آن توسط یک رگلاتور فشار، قبل از رسیدن به مخزن سیال تنظیم میشود. علاوه بر این، یک سنسور فشار برای نظارت بر فشار ورودی استفاده میشود.

۴- ۱- صحه گذاری روش تحلیلی برای مکانیزم منعطف

قبل از شناسایی و صحه گذاری دینامیک جامع سیستم، روش تحلیلی برای مکانیزم منعطف آزمایش می شود تا دقت عملکرد آن ثابت شود. به همین منظور دادههای بهدست آمده از روش تحلیلی با دادههای شبیه سازی المان محدود و دادههای تجربی مقایسه می گردند.

در این مطالعه، برای شبیه سازی رفتار مکانیزم منعطف، از مدل سازی المان محدود در نرمافزار انسیس استفاده شده است. هندسه مکانیزم به صورت شکل ۷ شبکه بندی شده و شامل ۱۶۳۵۲۲ المان است. اندازه المان ها در نواحی نازکتر مکانیزم به دلیل تغییر شکل بالاتر این نواحی، کوچکتر از سایر بخشها انتخاب شده است تا دقت شبیه سازی افزایش یابد. شرایط مرزی به گونه ای تعریف شده که بخش بالایی مکانیزم به صورت ثابت در



شکل ۶. اجزای آزمایش و ارتباط بین آنها



پل	منعطف	مكانيزم	هندسی	مشخصات	.1	جدول
----	-------	---------	-------	--------	----	------

Table 1. Geometric specifications of the bridge flexible mechanism

اندازه (میلیمتر)	پارامتر	اندازه (میلیمتر)	پارامتر
٩	h	• / ۶	T_f
٣/١	T_r	۲/۶۲	L_f
١٢/٩	l_o	٣/٢٣	$ heta_{\scriptscriptstyle eq}$
۱۵/۴	d	10/4	L_r



شکل ۷. هندسه شبکهبندی شده مکانیزم منعطف Fig. 7. Meshed geometry of the flexible mechanism

نظر گرفته شده و نیرو به دو طرف محل قرارگیری پیزوالکتریک اعمال می شود. در تحلیل استاتیکی، تغییر مکانها و توزیع جابجایی در مکانیزم شبیه سازی شده است که نشان می دهد تمامی جابجایی به قسمت تحتانی مکانیزم منتقل می شود، در حالی که بخش فوقانی ثابت باقی می ماند. همچنین تحلیل مودال برای شناسایی فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی مکانیزم انجام شده است. تمامی تحلیلها با بررسی استقلال از مش همراه بوده و نتایج نهایی پس از اطمینان از همگرایی گزارش شده اند. این فرآیندها دقت بالایی در شبیه سازی رفتار دینامیکی و استاتیکی مکانیزم تضمین می کنند.

الف) صحه گذاری استاتیک

برای صحهگذاری نسبت تقویت مکانیزم، یک موج سینوسی با فرکانس پایین به سیستم وارد می شود و جابه جایی هر دو طرف مکانیزم منعطف و حرکت پورت خروجی ثبت می شود. این فرایند سپس با استفاده از نرمافزار المان محدود تجاری انسیس و مدل ریاضی که در متلب کدنویسی شده بود، تکرار شد. داده های حاصل در شکل ۸ ارائه شده است.

همان طور که در جدول ۲ نشان داده شده است، نسبت تقویت به دست آمده از روش تحلیلی نشان دهنده انحرافی حدود ۴ درصد از مقدار تجربی است که کمتر از نرخ خطای مدل المان محدود با ۸/۳ درصد است. علاوه بر این، سختی پورت ورودی که از روش تحلیلی به دست آمده است، ۷/۶ درصد از نتیجه المان محدود فاصله دارد.

ب) صحه گذاری دینامیک

با استفاده از روش تحلیلی، معادله بدون میرایی حرکت سیستم قابل بهدست آوردن است که فرکانس طبیعی سیستم را میتوان با آن به دست آورد. با کمک توابع جستجوی ریشه صفر در متلب، فرکانسهای طبیعی سیستم که در واقع ریشههای دترمینان ماتریس سفتی دینامیکی است قابل محاسبه هستند. همچنین فرکانسهای طبیعی سیستم با نرمافزار المان محدود نیز به دست آمدهاند. چهار فرکانس تشدید اول که از المان محدود به دست آمدهاند، در جدول ۳ نشان داده شدهاند.



شکل ۸. نمودار صحه سنجی دامنه استاتیک مکانیزم منعطف

Fig. 8. Static amplitude validation diagram of the flexible mechanism

جدول ۲. مقایسه نتایج استاتیک در روش تحلیلی با المان محدود و أزمون تجربی

 Table 2. Comparison of static results using the analytical method, finite element analysis, and experimental testing

المان محدود	تحليلى	واقعى	
14/9	۱۵/۸۹	18/20	ضریب بزرگنمایی
۱٩/٩۵	۱٩/۵	-	سفتی ورودی (نیوتن بر میکرومتر)
λ/Υ	۴	-	خطای ضریب بزرگنمایی

جدول ۳. فرکانسهای طبیعی مکانیزم و شکل مودهای تشدید

Table 3. Natural frequencies of the mechanism and mode shapes of resonance



مقدار دترمینان ماتریس سفتی دینامیکی در شکل ۹ با استفاده از تغییر فرکانس از ۱ تا ۳۰۰ هرتز محاسبه شده است. این تحلیل بهمنظور شناسایی ریشههای دترمینان انجام شده است که نشاندهنده دو فرکانس طبیعی اول سیستم هستند.

برای آزمایش تجربی، در شکل ۱۰ یک سیگنال چیرپ خطی به سیستم داده شده است که فرکانس را از ۰ تا ۴۰۰ هرتز در طول دو دقیقه افزایش میدهد. از سیگنال خروجی همچنین تبدیل فوریه سریع^۱ گرفته می شود تا فرکانس های طبیعی در کل طیف مشخص شوند.

همان طور که در شکل ۱۰ نشان داده شده است، مود فرکانس اولیه مکانیزم منعطف در پاسخ چیرپ سیستم مشخص نیست. دلیل این امر ممکن است مربوط به این امر باشد که در شبیه سازی به روش المان محدود، مکانیزم انعطاف پذیر بدون در نظر گرفتن اثر عملگر پیزوالکتریک مدل سازی شده است. در مقابل، در تنظیمات آزمایشگاهی، عملگر پیزوالکتریک به صورت فشاری در داخل مکانیزم انعطاف پذیر قرار گرفته و به دلیل وجود تلرانس، اتصال صلبی میان آن ها برقرار نیست. این شرایط مرزی خاص باعث می شود

که هنگام نزدیک شدن پورتهای ورودی، عملگر پیزوالکتریک تحت فشار قرار گیرد، اما در هنگام دور شدن آنها، تحت کشش قرار نگیرد. چنین شرایط مرزی ناپیوستهای به سادگی در مدلهای المان محدود یا تحلیلی قابل پیادهسازی نیست و در مقالات مشابه، معمولاً مکانیزم انعطاف پذیر به تنهایی مدلسازی می شود تا از پیچیدگیهای غیرضروری جلوگیری شود[۲۶–۲۸] همچنین تشکیل مود در این فرکانس طبیعی لازمه پیچش شدید مکانیزم است اما با وجود قرار گرفتن پیزوالکتریک داخل این مکانیزم این حرکت توسط پیزو که سفتی بالاتری از مکانیزم دارد به شدت مستهلک می شود و اجازه تشکیل شدن را نمی دهد. با این حال مود اول در روش تحلیلی با نتایج المان محدود اختلاف کمی دارد و بقیه مودها نیز با خطای محدود با نتایج المان محدود منطبقاند(جدول ۴).

۴- ۲- صحه گذاری و شناسایی دینامیک کل سیستم

همان طور که قبلا ذکر شد، مدل غیرخطی هیسترزیس (معادله(۱۱)) و دینامیک تزریق (معادله (۲۸)) شامل ضرایب مجهول هستند که نیاز به شناسایی با دادههای تجربی دارند. سپس عملکرد مدل شناسایی شده می تواند

¹ Fast Fourier Transform (FFT)



شکل ۹. مقدار دترمینان ماتریس سفتی دینامیکی در فرکانسهای مختلف

Fig. 9. Determinant value of the dynamic stiffness matrix at different frequencies



شکل ۱۰. الف- پاسخ سیستم به چیرپ خطی. ب- FFT همان سیگنال در سمت راست.

Fig. 10. (a) System response to linear chirp. (b) FFT of the same signal on the right.

جدول ۴. مقایسه نتایج دینامیکی در روش تحلیلی با المان محدود و أزمون تجربی

ment analysis, and experimental testing					
مود چهارم	مود چهارم	مود سوم	مود دوم	مود اول	
٨٣۵/٣	۸۳۵/۳	$\Delta NV/\Delta$	TQY/L	180/17	روش تحليلى
V97/0	V97/۵	$\Delta \cdot \Upsilon / 1$	26 / V	179/4	المان محدود

788

_

آزمون تجربى

 Table 4. Comparison of dynamic results using the analytical method, finite element analysis, and experimental testing



شکل ۱۱. الف– ورودی شبهاستاتیک به سیستم. ب– پاسخ سیستم به ورودی شبیه استاتیک و مقایسه با مدل شناسایی شده در یک حلقه.

Fig. 11. (a) Quasi-static input to the system. (b) System response to the quasi-static input and comparison with the identified model in a closed loop.

برای سیگنالهای ورودی مختلف آزمایش شود تا دقت آن تأیید شود. برای شناسایی دقیق هیسترزیس و دینامیک تزریق، بهتر است که این عمل در دو مرحله صورت پذیرد. مرحله اول شناسایی هیسترزیس است و مرحله دوم شناسایی ضرایب ناشناخته در دینامیک تزریق است.

مرحله 1: ضرایب درون تابع هیسترزیس میتوانند با وارد کردن یک سیگنال با فرکانس پایین به سیستم شناسایی شوند، همان طور که در شکل ۱۱ (الف) نشان داده شده است. دلیل ورودی فرکانس پایین این است که در این حالت، دینامیک سیستم در خروجی تأثیر نمیگذارد و در نتیجه شناسایی هیسترزیس دقیق تری انجام میپذیرد. تفاوت عمده بین یک میراگر معمولی و رفتار هیسترزیس این است که تاثیر میراگر تنها در فرکانسهای بالا بارز است، اما تاثیر هیسترزیس در هر دو فرکانس پایین و بالا واضح است.

شکل ۱۰ (ب) سه ثانیه اول سیگنال را نشان میدهد که نمایانگر ظهور رفتار هیسترزیس است. مدل شناسایی شده دقت پیش بینی این رفتار نشان میدهد، خطای جذر میانگین مربعات^۲ ۱/۷۴ و مقدار ضریب تعیین ۰/۹۹ به دست آمده اند.

مرحله ۲: برای تعیین ضرایب مجهول در مدل پیشنهادی برای تزریق، شبیه سازی با استفاده از تابع تبدیل در معادله (۲۹) انجام انجام شده است. نوع سیگنال های استفاده شده برای شناسایی دینامیک سیستم، ترکیبی از ورودی های سینوسی با فرکانس ها و دامنه های متفاوت است، که به گونه ای

1 Root Mean Squared Error (RMSE)

طراحی شدهاند که فرکانسها تاحد امکان نسبتهای عددی صحیح نداشته باشند و با یکدیگر همپوشانی نکنند. این روش با برانگیختن طیف وسیعی از دینامیک سیستم، شناسایی دقیق رفتار آن را ممکن میسازد و مدل حاصل را برای پیشبینی رفتار عمومی سیستم در شرایط مختلف بسیار دقیق و قابل اطمینان میکند.

با استفاده از تابع اف مین کان^۲ در متلب، پارامترهای β_1 ، β_2 و با استفاده از تابع اف مین کان^۲ در متلب، پارامترهای β_3 ممکن β_3 با تعداد محدودی از تکرارها شناسایی شدند تا کمترین خطای ممکن حاصل شود. سیگنال ورودی استفادهشده برای شناسایی به صورت زیر است $5\sin(6\pi t) + 9\sin(10\pi t) + 13\sin(14\pi t) + 3\sin(18\pi t)$

نتایج فرایند شناسایی پارامترها در جدول ۵ ارائه شده است.

شکل ۱۲ پاسخ سیستم به ورودی ذکر شده است که با شبیهسازی مقایسه می شود. خطای جذر میانگین مربعات و مقدار ضریب تعیین برای شناسایی به ترتیب ۲/۵۳ و ۰/۹۷۱ هستند که نشان دهنده دقت بالای شناسایی است. برای صحه گذاری نتیجه، سیگنال های دیگری با فرکانس های بالاتر و دامنه های متفاوت به سیستم داده شدهاند:

سيگنال اول:

 $5\sin(16\pi t) + 9\sin(26\pi t)$ + $17\sin(46\pi t) + 13\sin(54\pi t)$

² Fmincon

جدول ۵. ضرایب شناسایی شده دینامیک سیستم

Table 5. Identified dynamic coefficients of the system

\mathcal{O}_n	Ľ	eta_3	eta_2	$eta_{ m l}$	پارامتر
940/08	۲/۶۷۷×۱۰ ^۵	$\gamma/9 \cdot \gamma \times 1 \cdot 2$) Y/))	۲/۷۱	مقدار شناسایی شده



شکل ۱۲. مقایسه خروجی سیستم با مدل شناسایی شده



سیگنال دوم:

مقادیرخطای جذر میانگین مربعات و مقادیر ضریب تعیین برای سیگنال ۱ بهترتیب ۴/۰۴ و ۶/۹۶ هستند. مقادیر مشابه برای سیگنال ۲ بهترتیب ۴/۳۵ و ۲/۹۵ و برای سیگنال ۳ بهترتیب ۴/۹۵ و ۲/۹۵ هستند.

 $7\sin(66\pi t) + 10\sin(26\pi t)$ + $17\sin(46\pi t) + 13\sin(54\pi t)$

سیگنال سوم:

 $\frac{10\sin(270\pi t) + 15\sin(78\pi t)}{+23\sin(138\pi t) + 19\sin(162\pi t)}$

در شکل ۱۳ پاسخ شبیهسازی با سیگنالهای مرجع بهدستآمده از آزمایش تجربی مقایسه شدهاند.

۵- نتیجهگیری

در این مطالعه یک دستگاه تزریق قطره سیال پیزوالکتریک مدل سازی و ساخته شده است که شامل مکانیزم منعطف نوع پل است. در ضمن این مدل سازی روشی توسعهیافته است که در آن المانهای سری با هم دادغام شده و محاسبات را سادهتر و برای به کارگیری در بررسی دینامیک چندجسمی سیستم و شناسایی آن آسانتر مینماید. علاوه بر این، یک روش مدل سازی غیرخطی مبتنی بر هیسترزیس عملگر برای توصیف رفتار پیزوالکتریک به کاررفته است. دقت مدل در توصیف رفتار استاتیکی و دینامیکی مکانیزم منعطف از طریق صحه گذاری با دادههای تجربی و





Fig. 13. Comparison of system output with the identified model: (a) First signal, (b) Second signal, (c) Third signal

Conference Series: Earth and Environmental Science, 714(3) (2021) 032081.

- [8] G. Deng, W. Cui, C. Zhou, J. Li, A piezoelectric jetting dispenser with a pin joint, Optik, 175 (2018) 163-171.
- [9] J. Jeon, S.-M. Hong, M. Choi, S.-B. Choi, Design and performance evaluation of a new jetting dispenser system using two piezostack actuators, Smart Materials and Structures, 24(1) (2015) 015020.
- [10] M.A. Trimzi, Y.B. Ham, B.C. An, Y.M. Choi, J.H. Park, S.N. Yun, Development of a Piezo-Driven Liquid Jet Dispenser with Hinge-Lever Amplification Mechanism, Micromachines, 11(2) (2020) 117.
- [11] J.W. Sohn, S.-B. Choi, Identification of Operating Parameters Most Strongly Influencing the Jetting Performance in a Piezoelectric Actuator-Driven Dispenser, Applied Sciences, 8(2) (2018) 243.
- [12] C. Zhou, J.a. Duan, G. Deng, J. Li, A Novel High-Speed Jet Dispenser Driven by Double Piezoelectric Stacks, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(1) (2017) 412-419.
- [13] R. Zhao, S. Lv, G. Chen, J. Chen, Q. Wang, M. Wu, J. Zheng, Design and experiment of a new double needle type piezoelectric jetting dispenser, Smart Materials and Structures, 32(3) (2023) 035022.
- [14] L. Cao, S.G. Gong, Y.R. Tao, S.Y. Duan, Optimizing dispensing performance of needle-type piezoelectric jet dispensers: a novel drive waveform approach, Smart Materials and Structures, 33(4) (2024) 045001.
- [15] C. Zhou, J. Li, J.A. Duan, G. Deng, Direct-Acting Piezoelectric Jet Dispenser With Rhombic Mechanical Amplifier, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 8(5) (2018) 910-913.
- [16] G. Deng, N. Wang, C. Zhou, J. Li, A Simplified Analysis Method for the Piezo Jet Dispenser with a Diamond Amplifier, Sensors, 18(7) (2018) 2115.
- [17] X. Chen, Z. Deng, S. Hu, X. Gao, J. Gao, Research on three-stage amplified compliant mechanism-based piezo-driven microgripper, Advances in Mechanical Engineering, 12(3) (2014) 1687814020911470.

شبیه سازی المان محدود مقایسه شده است. ویژگیهای استاتیکی شامل نسبت تقویت و سختی ورودی نشان دهنده خطایی کمتر از ۶ درصد در تمام مقایسه ها است، همچنین ویژگیهای دینامیکی، یعنی فرکانسهای طبیعی، خطای کمتر از ۶ درصد برای فرکانس طبیعی دوم و ۸ درصد برای فرکانس طبیعی اول را نشان می دهد. شناسایی و صحه گذاری رفتار غیر خطی هیسترزیس و دینامیک جامع سیستم نشان دهنده مقدار ضریب تعیین بالای ۸۹۸۰ برای تمام سیگنالهای ورودی است که دقت مدل را تأیید می کند. این مدل پتانسیل لازم برای استفاده در طراحی و بهینه سازی دستگاههای تزریق قطره سیال پیزوالکتریک و همچنین در طراحی سیستمهای کنترلی را دارد.

منابع

- S. Lu, X. Chen, H. Zheng, Y. Zhao, Y. Long, Simulation and Experiment on Droplet Volume for the Needle-Type Piezoelectric Jetting Dispenser, Micromachines, 10(9) (2019) 623.
- [2] S. Lu, J. Zhang, Y. Liu, H. Zheng, C. Ren, W. liu, Droplet formation study of a liquid micro-dispenser driven by a piezoelectric actuator, Smart Materials and Structures, 28(5) (2019) 055003.
- [3] L. Wang, X. Huang, S. Lin, Z. Bu, H. Jin, X. Lin, Z. Lin, P. Xie, Design and experiment of a jetting dispenser with compact amplifying mechanism and low stress in piezostack, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 31(5) (2020) 788-798.
- [4] S. Zhou, P. Yan, Design and Analysis of a Hybrid Displacement Amplifier Supporting a High-Performance Piezo Jet Dispenser, Micromachines, 14(2) (2023) 322.
- [5] Y. Shi, A. Huang, B. Fu, Design and performance analysis of a piezoelectric jetting dispensing valve, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 35(10) (2024) 920-941.
- [6] H. Peng, J. Deng, G. Deng, C. Zhou, J. Li, Design and Research of a Novel Piezostack-Driven Jetting Dispenser With a Diamond Spring, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 12(11) (2022) 1849-1856.
- [7] G. Li, C. Zhou, Rigid flexible coupling dynamic analysis of piezoelectric jetting dispenser based on ADAMS, IOP

Trajectory Tracking Control of Piezoelectrically Driven Micro/Nanopositioning Systems, IEEE Transactions on Control Systems Technology, 15(5) (2007) 867-878.

- [24] H. Ghafarirad, S.M. Rezaei, A. Abdullah, M. Zareinejad, M. Saadat, Observer-based sliding mode control with adaptive perturbation estimation for micropositioning actuators, Precision Engineering, 35(2) (2011) 271-281.
- [25] J. Gan, X. Zhang, H. Wu, A generalized Prandtl-Ishlinskii model for characterizing the rate-independent and rate-dependent hysteresis of piezoelectric actuators, Review of Scientific Instruments, 87(3) (2016) 035002.
- [26] M. Ling, J. Cao, N. Pehrson, Kinetostatic and dynamic analyses of planar compliant mechanisms via a twoport dynamic stiffness model, Precision Engineering, 57 (2019) 149-161.
- [27] M. Ling, C. Zhang, L. Chen, Optimized design of a compact multi-stage displacement amplification mechanism with enhanced efficiency, Precision Engineering, 77 (2022) 77-89.
- [28] M. Ling, X. Zhang, J. Cao, Extended Dynamic Stiffness Model for Analyzing Flexure-Hinge Mechanisms With Lumped Compliance, Journal of Mechanical Design, 144(1) (2021) 013304.

- [18] M. Ling, J. Wang, M. Wu, L. Cao, B. Fu, Design and modeling of an improved bridge-type compliant mechanism with its application for hydraulic piezovalves, Sensors and Actuators A: Physical, 324 (2021) 112687.
- [19] Y. Li, X. Zhu, S. Bi, R. Guo, J. Sun, W. Hu, Design and development of compliant mechanisms for electromagnetic force balance sensor, Precision Engineering, 64 (2020) 157-164.
- [20] Z. Bu, S. Lin, X. Huang, A. Li, D. Wu, Y. Zhao, Z. Luo, L. Wang, A novel piezostack-driven jetting dispenser with corner-filleted flexure hinge and highfrequency performance, Journal of Micromechanics and Microengineering, 28(7) (2018) 075001.
- [21] M. Wu, R.-M. Zhao, J.-N. Chen, J.-J. Zheng, B.-K. Shao, Design and performance analysis of a flexiblehinged piezoelectric driving dispenser, Smart Materials and Structures, 33(4) (2024) 045014.
- [22] M. Ling, X. Zhang, Coupled dynamic modeling of piezo-actuated compliant mechanisms subjected to external loads, Mechanism and Machine Theory, 160 (2021) 104283.
- [23] S. Bashash, N. Jalili, Robust Multiple Frequency

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم P. Firuzy Rad, H. Ghafarirad , S. M.i Rezaei, Comprehensive Dynamic Modeling and Characterization of a Piezoelectric Droplet Dispenser, Amirkabir J. Mech Eng., 56(10) (2025) 1429-1450.



DOI: 10.22060/mej.2025.23611.7788